高出力放電励起エキシマレーザの開発と極短波長レーザの研究 Development of discharge pumped excimer lasers and short-wavelength laser research

宮崎健創、挾間寿文、山田家和勝、酒井広文、佐藤卓蔵 Kenzo Miyazaki Toshifumi Hasama. Kawakatsu Yamada. Hirofumi Sakai and Takuzo Satc 電子技術総合研究所 Electrotechnical Laboratory

Several discharge-pumped excimer lasers which constitute a short-pulse excimer laser amplification system have been developed for XUV laser research. These are a compact oscillator generating ns pulses, some automatically-preionized devices and a high-power X-ray preionzed laser device with an output energy of 50 J in 85ns pulses. The coherent VUV/XUV generation systems have also been developed using excimer laser pumped dye lasers, which can produce coherent radiation in a wavelength region of 70-200nm by two-photon resonant four wave mixing.

1.はじめに

F 8

放電励起エキシマレーザの出現以来、その進歩は著しく、最近では様々な実用的な装置が開発され、エレクトロニ クス、加工、光化学、計測等の多くの科学技術分野で利用されるようになってきた。一方、エキシマレーザを励起源 とする新レーザの研究が注目されつつある。エキシマレーザの持つ紫外・高出力、高効率短パルス増幅といった優れ た機能を利用して、レーザ技術にとって未踏のスペクトル領域である極端紫外(XUV)、さらにはX線領域におけるレ ーザ技術を開発しようとするものである[1]。筆者等は、高性能な放電励起エキシマレーザ技術、ならびにそれを利 用したXUV レーザ励起用短パルスエキシマレーザ増幅システムの開発、及びエキシマレーザ励起色素レーザーを基本 波とする4光波混合を用いた連続波長可変コヒーレントVUV/XUV 光源技術の開発を進めている[2]~[8]。「ig.1は、 この極短波長レーザ技術開発のためのシステム構成である。ここでは、極端紫外レーザ励起用短パルスエキシマレー ザ増幅システムの開発を当面の課題とし、そのために試作開発した大口径放電エキシマレーザ増幅装置についてその 概要を述べるとともに、エキシマレーザ励起色素レーザを基本波とする波長可変コヒーレントVUV/XUV 光源技術の開 発について報告する。

2. 大口径放電励起エキシマレーザ増幅装置

大街面積エキシマレーザビームを得るための大出力放電励起エキシマレーザの開発、ならびに短パルスエキシマレ ーザ増幅システムの最終段増幅器の開発を目的として、大口径X線予備電離放電エキシマレーザ装置を試作した[5]。 Fig.2 に、その装置構成を示す。子備電離用X線は、冷陰極電子ビームをタンタル箔に照射することによって発生す る。発生したX線は、厚さ1mmのAl窓を通してレーザ放電管に導かれる。レーザ電極は、幅170mm、長さ1200mmの高 電圧電極と厚さ1mmのAl平面電極によって構成した。レーザ励起回路は、10段マルクス電源、パルス整形線路(PFL)、レールギャップスイッチ(RGS)、及びパルス伝送線路(PTL)によって構成されている。PFL 及びPILのための誘 電体として水を用いており、PFL の容量、特性インピーダンス、及び電圧パルス往復時間は、それぞれ52nT、0 87Ω、 及び90nsである。また、PTL の電圧パルス伝送時間は45nsである。PTL は、P1L を構成する3枚の平板の間隔をRGS から放電管に向かって次第に狭めることによりインビーダンス変換されている。この装置で得られた最大の放電体積 は100x100x1100mm³であった。Fig.3 に本装置をXeClレーザとして動作させたときの充電電圧(V prt)に対するレ ーザ出力、及び電気効率を示す。レーザガスは、HCl/Xe/Ne-4/20/4476 Terrである PTLのインピーダンス変換の効果 を調べるため、0.87Ω→0.48Ω、及び0.87Ω→0.26Ωへ変換されたPTL を用いて実験を行った。Fig.3 に示したよう に、0.26Ωへ変換されたPTL を用いたときの出力は、0.48Ωへ変換されたPTL を用いたときの出力に比べて、V prt =148kVのときを除いて13~15% 増加した。最大の効率は、V prt =148kVの時で3.1%(出力:17.6J)であった。この また、最大出力はV prt = 400kVの時50J (パルス幅:85ns, レーザパルス尖頭値:0.66W)である。

3. 波長可変コヒーレントVUV光源

共鳴4光波混合を利用し、波長200nm から50nmのVUV域で連続的に波長可変とできる技術の開発を当面の課題に している。基本波としてXeclレーザ励起色素レーザ、非線形媒質としてヒートパイプオーブン中で生成した金属蒸気、 及び希ガスの超音速ビームを利用している。LiF結晶の透過限界(約105nm)より長波長域では、非線形媒質として 金属蒸気を利用する。Cdを用いた場合、6¹S₀、5¹D₂を2光子共鳴準位として115~150nm の範囲で波長可変 VUV光発生が可能であった。VUV光の最大出力は約200W、最大変換効率は約0.1%、VUV光出力のスペクトルの 幅(FWHM)は0.001nm 以下であり、高輝度高分解能の優れた特性を備えている[6]。

XUV領域におけるコヒーレント光の発生では、Kr、及びXeを非線形媒質として利用している。超音速ビームは、 直径1mm のノズルから基本波用レーザと同期してパルス的に供給される。Fig.4 にXeとkrでの4光波混合過程を示す。 2光子共鳴に必要な基本波は、BBO 結晶[7] による色素レーザの第2高調波(10 ~20kW) であり、共鳴波長は216.7m m である。krで72.2nmまでのコヒーレントXUV光の発生を実現している[8]。

- 参 考 文 献
- [1] 宮崎、佐藤:電気学会雑誌 105,525(1985); 電総研イ報 49,469(1985).
- [2] K. Yamada, K. Miyazaki and T. Sato: To be published in IEEE J. Quantum Electron.
- [3] K. Miyazaki, Y. Toda, T. Hasama and T. Sato: Rev. Sci. Instrum. 56 201(1985), K. Miyazaki, T. Hasama, K. Ymada, T. Fakatsu T. Eura and T. Sato: J. Appl. Phys. 60, 2721(1986).
- [4] 深津、山下、宮崎、挾間、山田、佐藤、金子、木本、:昭和61年度春季応物学会 2a-L5(1986).
- [5] T.Hasama, K.Miyazaki, K.Yamada, K.Ohuchi and T.Sato: J.Appl. Phys. 61, 4691(1987).
- [6] K. Miyazaki, H. Sakai and T. Sato: Opt. Lett. 9, 457(1984); K. Miyazaki, H. Sakai and T. Sato: IEEE J. Quantum Electron. QE-22, 2266 (1986).
- [7] K. Miyazaki, H. Sakai and T. Sato: Opt. Lett. 11, 797(1986).
- [8] 酒井、宫崎、佐藤:昭和62年度秋季応物学会 17p-ZC-3(1987).



Fig.1 Schematic diagram of an excimer laser amplification system and a coherent VUV/XUV generation system for short-wavelength laser research.



Fig.3 Laser output energy and electrical efficiently as a function of PFL voltage.



Fig.2 Schematic diagram of the X-ray preionized discharge pumped excimer laser.



Fig.4 Simplified energy level diagrams of Xe and Kr showing the coherent XUV generation processes by two-photon resonant four wave mixing.